

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-312900  
 (43)Date of publication of application : 26.11.1996

(51)Int.Cl.

F17D 1/02

(21)Application number : 07-145432

(71)Applicant : CKD CORP

(22)Date of filing : 19.05.1995

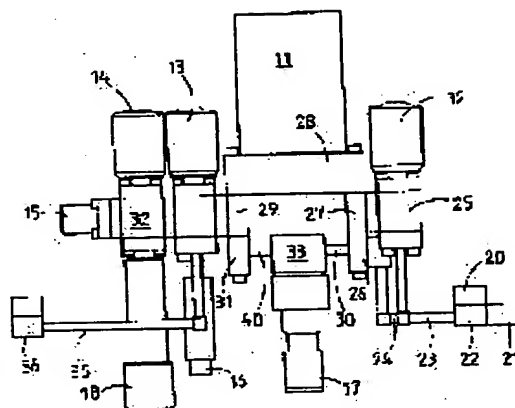
(72)Inventor : BANDOU HIROSHI

## (54) GAS SUPPLYING AND ACCUMULATING UNIT

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a gas supplying and accumulating unit capable of being arranged in a narrow floor space.

CONSTITUTION: A gas supplying and accumulating unit is provided by integrally constituting inlet and outlet opening/closing valves 14 and 12 for shutting off the flow of a corrosive gas, and a mass flow controller 11 being located in the middle between inlet and outlet opening/closing valves 14 and 12 to control the flow rate of the corrosive gas, as a mass flow unit; and arranging a regulator 17 for adjusting gas pressure, a pressure gage 16 for monitoring pressure, and a manual valve 18 for manually shutting off the flow of the corrosive gas, in parallel to the mass flow unit, to be integrated. The output port of the outlet opening/closing valve 12 and the output common passage 20 of a gas supply system main body are communicated to make the gas supplying and accumulating unit be detachably fittable to a gas supply system main body by an output block 22.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 22.06.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2832166

[Date of registration] 25.09.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-312900

(43) 公開日 平成8年(1996)11月26日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup>  
F17D 1/02

識別記号 庁内整理番号

F 1  
F17D 1/02

技術表示箇所

審査請求 有 請求項の数 8 F D (全12頁)

(21) 出願番号 特願平7-145432  
(22) 出願日 平成7年(1995)5月19日

(71) 出願人 000106760  
シーケーディ株式会社  
愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地  
(72) 発明者 板藤 寛  
愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地  
シーケーディ株式会社内  
(74) 代理人 弁理士 富澤 孝 (外2名)

(54) 【発明の名称】 ガス供給集積ユニット

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】 狭いフロアスペースに配設可能なガス供給集積ユニットを提供すること。

【構成】 腐食性ガスの流れを遮断する入口開閉弁14及び出口開閉弁12と、入口開閉弁14と出口開閉弁12の中間にあって腐食性ガスの流量を制御するマスフローコントローラ11とをマスフローユニットとして一体的に構成し、ガス圧を調整するレギュレータ17と、圧力をモニターするための圧力計16と、腐食性ガスの流れを手動により遮断する手動弁18とを、マスフローユニットと並列に配設して一体化しガス供給集積ユニットとする。出口開閉弁12の出力ポートとガス供給システム本体の出力共通流路20とを連通し、出力ブロック22によってガス供給集積ユニットをガス供給システム本体に対して着脱自在に取り付け可能とする。

